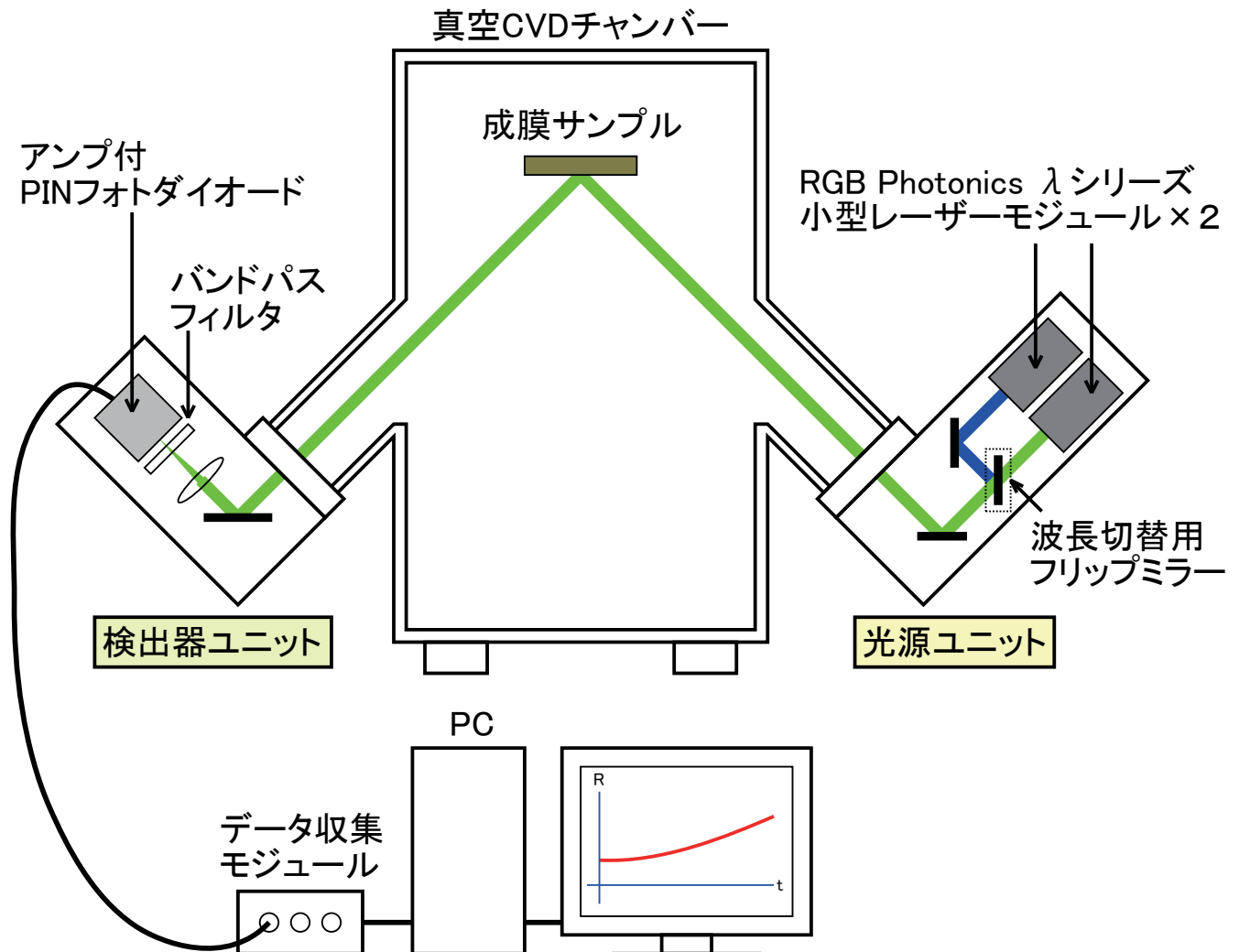


アプリケーション事例

成膜チャンバー内反射率モニタリングシステム



上図は、レーザーモジュール λ シリーズの小型・軽量・高い安定性の特長を活かしたアプリケーション事例で、真空 CVD チャンバー内にある成膜サンプルの反射率をリアルタイムで観測するためのシステムです。

システムは光源ユニットと検出器ユニットから構成されており、真空ポンプによるチャンバーの振動等の影響を低減するため、両ユニットとも真空チャンバーのビューポートのフランジに直接マウントしています。

光源ユニットは波長の異なる複数個のレーザーモジュール（出力数十mW）を搭載しており、複数の波長を切り替えて各波長での反射率を観測することが可能です。検出器ユニットは集光レンズと広帯域アンプ付き PIN フォトダイオード及び迷光をカットするためのバンドパスフィルタによって構成されており、マイクロ秒以下の高い時間分解能で、成膜中のサンプル表面の反射率に比例した信号をリアルタイムで測定・記録する事が可能です。



株式会社 東京インスツルメンツ
TOKYO INSTRUMENTS, INC.

E-Mail: sales@tokyoinst.co.jp

Web site: <http://www.tokyoinst.co.jp/>